

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

移动式弧光放电离子镀膜设备

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

192

下载

0

收藏

0

作者 于志明, 牛云松, 何宇廷 and 崔荣洪**发表日期** 2011-03-16**专利国别** 中国**专利类型** 实用新型**权利人** 中国科学院金属研究所

中文摘要 本实用新型涉及离子镀膜设备领域,具体为一种移动式弧光放电离子镀膜设备,可应用到飞机大型构件的功能化处理,也可推广应用到航天飞行器、大型客货船等大型或重型器件的表面耐磨、耐蚀以及各种功能性镀膜处理。抽气机组的抽气口与真空腔体的排气口相连接,蒸发源电源控制单元的正极和负极分别连接于真空腔体的外壳和蒸发源的靶材上;偏压电源的正极和负极分别连接于真空腔体的外壳和被镀工件上;复合真空计的高、低真空规探头分别与安装在真空腔体底部的离子真空规管和热阻规管相连接;温度监测单元与安装在真空腔体底部的热电偶相连接。本实用新型解决不便装入镀膜设备真空室内的大型部件、不宜拆卸搬运器件的局部镀膜处理等问题。

公开日期 2011-03-16**语种** 中文**专利申请号** CN201762436U**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/67928>] **专题** 金属研究所_中国科学院金属研究所**推荐引用方式** 于志明, 牛云松, 何宇廷 and 崔荣洪. 移动式弧光放电离子镀膜设备. 2011-03-16.**GB/T 7714**[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号